@Int Cl 4

識別記号

广内整理番号

□ 個公開 昭和61年(1986)10月4日

G 09 G 3/36 G 02 F 1/133 G 09 F 9/30

7436-5C D-8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁) 6810-5C

の発明の名称

アクティブマトリツクス基板

②特 3 類 3 昭60 - 63401 (4 4 5 4 5 4 6

20出 顧 昭60(1985)3月29日

砂発 明 耂

宮

,門真市大字門真1006番地。松下電器産業株式会社内

勿発 明

隆 夫 門真市大字門真1006番地。松下軍器產業株式会社内

清一 73発 明 永

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

頗 砂出 多代

松下電器産業株式会社

恒司

門頁市大字門頁1006番地

- 発明の名称 アクティブマトリックス基板
- (1) 映像表示領域に配設された透明電極から、 なる複数の映像表示手段と、前記映像表示手段をお ドレインに接続させて、透光性基板上に形成した。 複数の第1の薄膜トランジスタと、前記第1の薄 膜トランジスタを駆動するための信号が入力する。、多結晶シリコン或いは水素化非晶質シリコンを一 ソース配線群及びゲード配線群と、前記ソース配。 線群の各線にドレインをそれぞれ接続した複数の 第2の篠膜トランジスタと、前記複数の第2の篠 膜トランジスタのソースに接続した線を複数本毎 に束ねてなる複数の映像信号入力配線と、前記複 数の第2の弾膜トランジスタのゲートに接続した。 複数の信号切換用ゲート配線とが具備されている ことを特徴とするアクティブマトリックス基板。
- (2) 前記第2の辞膜トランジスタは、前記映 像表示領域のいずれか一辺で、前記映像信号入力。 配線と前記ソース配線群とに接続されることを特 ...

徴とする特許請求の範囲第(1)項記載のアクティ ブマトリックス基板。

- (3) 前記第2の薄膜トランジスタは、前記映 像表示領域のいずれか二辺で、前記映像信号入力 、配線と前記ソース配線群とに接続されることを特 、微とする特許請求の範囲第(1)項記載のアクティ プマトリックス基板。
- (4) 前記第1及び第2の薄膜トランジスタは、 構成要素として含むことを特徴とする特許請求の 範囲第(1)項記載のアクティブマトリックス基板。 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、透光性基板上に確膜トランジスタを マトリックス状に形成したアクティブマトリック ス基板に関するものであり、液晶を用いた表示数 置等に用いられるものである。

(従来の技術)

近年、透光性基板に薄膜トランジスタを用いた アクティブマトリックス基板の開発が活発である。

貫うまでもなく、これ等のアクティブマトリック ス基板は被晶等を用いた。表示数量を目的としたも のであるが、将来的には、大型の一次元或いは二 次元イメージセンザ等の可能性もあり、fk広い応用 が考えられる。

クティブマトリックス基板の回路構成を示すもの で、1は多結晶シリコン或いは非晶質シリコンを その一構成要素とする遊光性基板(図示しない)上 に形成した薄膜トランジスタ、2は薄膜トランジ スタ1のドレインに電気的に接続した透明電極と、 カラーフィルタを形成する選光性基板上の透明な 対向電極との間に被晶を往入した被晶表示体で、 この被晶表示体2は映像表示領域3の各画素と対 応する位置に配設されており、液晶による容量以 外に、補助容量としてアクティブマトリックス基 板に形成される容量が付加されることもある。 4 は薄膜トランジスタ1のゲートに接続したゲート 配線、5は薄膜トランジスタ1のソースに接続し たソース配線である。

しかしながら、前者のプレキシブルブリント基(作用) 板によるゲート配線4及びソース配線5との直接 映像表示領域に配設した薄膜トランジスタのゲ 接続は、液晶表示装置の解像度を向上させるため 一ト配線に印加する信号と、ソース配線に直列に 合には、映像表示領域3の外周部にシフトレジス 信号を印加するかを選択できる。 タを設けなければならないので、歩留りが低下す。(実施例) ると共に、特に、水平操作のためには、高い移動・・以下図面により、本発明の実施例を詳細に説明、は、は、 薄膜トランジズタを形成する材料が限定されると 第1回は、本発明の一実施例におけるアクティ いう間頭があった。

もので、歩留りが大幅に向上し、且つ、製造原価 が安くなるアクティブマトリックス基板を提供す ることを目的とするものである。

(問題を解決するための手段)

本発明は、映像表示領域に配設された蒋膜トラ ンジスタのソース配線に映像信号を印加するソー ス配線を数本1組にして接続するものである。

このように構成された従来例では、ゲート配線 、4 から1つのゲートラインを選択すると、ソース 配線5を通して雑膜トランジスタ1のドレインと 電気的に接続される透明電極に所定の電位が与え られる。このとき、透明電極と対向電極との間に 第4回は、薄膜トランジスタを用いた従来のアーニ 往入されている被品の光旋光性が変化して、2枚 の偏光板により光透過率が変化するもので、以下、 同様に、ゲート配線4から1つのゲートラインを 🤼 🕏 順次選択していくことにより、エフィールドの画 面が形成される。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで、アクティブマトリックス基板と外部 駆動回路との接続は、フレキシブルプリント基板 接続する(例えば、特開昭52-116185号参照)か、 此いは、映像表示領域外にシフトレジスタを設け て、このシフトレジスタでゲート配線4若しくは ソース配線 5を選択して、外部回路との接続本数 を少なくする方法がとられる(例えば、特開昭58 - 219595号参照)。

に菌素数を増加させた場合には、配線間のピッチ 接続した薄膜トランジスタの信号切換用ゲート配 が小さくなるので、実装が非常に困難となる問題 線に印加する信号とを制御することにより、映像 があった。又、後者のシフトレジスタを用いる場で、 表示領域に配設したどの薄膜トランジスタに映像

プマトリックス基板の回路図であり、6は、コー 本発明は、前述のような問題に鑑みてなされた ニング社#7059、石英等の選光性基板(図示しな い)上に形成した半導体帯膜(図示しない)、ゲー ト絶縁膜(図示しない)、ゲート配線7及びソース 配線8からなる確膜トランジスタ、9は確膜トラー ンジスタ6のドレインに接続した液晶表示体で、 辞限トランジスタ6と被晶表示体9とは、それぞ れ、映像表示領域10の各國素と対応する位置にマ トリックス状に配設されており、而も、マトリッ

クス状に配設された各薄膜トランジスタ 6 のゲー トはゲート配線7によって行毎に並列接続され、・・ ソースはソース配線8によって列毎に並列接続さ れている。尚、半事体薄膜には、プラズマCVD 法によって形成した水菜化非晶質Si、若しくは、 波圧 C V D 法或いは電子ビーム蒸着法によって形 成した多結品Siを用い、又、ゲート絶縁膜には、 プラズマCVD法によって形成したSINI. SiOx、CVD法によって形成したSiOx、若し くは、半導体層の熱酸化膜を用い、更に、ゲート 配線7及びソース配線8には、DCスパッタリン グ法によって形成したMo, W, Cr或いはA1等 の金属材料或いはMoSi.等の金属硅化物、減圧。 CVD法によって形成した多結晶Si、若じくは、 DCスパッタリング独裁いはRFスパッタリング 法によって形成したSnO., InO. 或いは In.O.(SnO.)等の透明電極材料を用いればよ く、ゲート配線7及びソース配線8の配線用材料 は多層で用いてもよい。11は、それぞれ、映像表 示領域10の外側において各ソース配線8に直列に

接続した薄膜トランジスタ、12は隣接する3つの こうご 『薄膜トランジスタ11のツースを並列に接続した機 数の映像信号入力配線、13は3つ目毎の薄膜トラ ンジスタ11のゲートを順次並列に接続した複数の 信号切換用ゲート配線である。 このように構成された本実施例の動作を、各配 線に印加する駆動パルス及び信号電圧を示した第 2回を参照しながら、説明する。紹介した2月日の27年に という先ず、時間 はでは深色パルス信号が置がゲードにより なっぷ 記線7の7.を介して各導膜トランジズタ6のゲー 号切換用ゲート配線13の13aを介して確膜トランス ジズタ11aのゲートに印加されるので、映像信号 5 ()。 大力配線12を介して各澤膜トランジスタ11のソー・スペー スに印加されているパルス信号Vsが、審膜トラージングの ンジスタ11a及びソース配線 8aを介して存腹トラ ンジスタ 6a,のソースに印加されて、篠腹ドラン 河 ジスタ6mgのドレイン電圧は所定の設定電圧となった。 (後ょうして)、 なぶていねりはなく一 しおかしがっせん

こ^で又、時間も。では、パルス信号するがゲート配っ

線7の7、を介して各球酸トランジスタ6のゲートに印加されている状態で、パルス信号 *。が信号切換用ゲート配線13の13bを介して球膜トランジスタ11bのゲートに印加されるので、映像信号入力配線12を介して各球酸トランジスタ11b及びソース配線8bを介して球膜トランジスタ11b及びソース配線8bを介して球膜トランジスタ6b。のドレイン電圧が所定の設定電圧となる。

更に、時間も、では、パルス信号 * c. がゲート配線 7 の 7 、を介して各薄膜トランジスタ 6 のがートに印加されている状態で、パルス信号 * e が信号切換用ゲート配線 13 の13 c を介して薄膜トランジスタ 11 c のゲートに印加されるので、映像信号入力配線 12 を介して各薄膜トランジスタ 11 のソースに印加されているパルス信号 V s が、薄膜トランジスタ 11 c 及びソース配線 8 c を介して薄膜トランジスタ 6 c. のソースに印加されて、薄膜トランジスタ 6 c. のドレイン電圧が所定の設定電圧と

以下、前述の如き動作が順次繰り返して行なわれて、第nの水平操作ラインの薄膜トランジスタ Gaa, Gba及び Gcaのドレイン電圧が順次所定の設定電圧になれば、1 画面分の走査が完了し、信号表示のため各画素が選択されて、画像表示が可

能となる。

第3回は、本発明の他の実施例の構成を示した。としてと、ができる。 しょう おましかいり シャー・ミュー メルディ もので、第1回の符号と同一符号のものは同一部に表し、(発明の効果)に、良いで、なべて、このなかです。 分を示しているが、前述の実施例においては、映。」、以上説明したように、本発明によれば、アクテ 像倡号入力配線12の全ての端子 Vs., Vs., Vs., Carly マトリックス基板を用いた液晶表示装置或い Vs.,・・・を、映像表示領域10の上部にまとめ、 は他の材料を用いた表示装置において、解像度を て設けたが、本実施例においては、例えば、映像。 向上させるために画素数が増加しても、複雑なシ 借号入力配線12の奇数番目の端子、V sange V sange マストレジスタを形成する必要がなくなるので、フ ・を映像表示領域10の上部に設け、又、映像信号 レキシブルブリント基板による実装が容易できる 入力配線12の偶数番目の端子 Vss , Vss , ようになると共に、外部回路との接続本数がJ/3 を映像表示領域10の下部に設けたものであり、本以下になって、配線ピッチが従来の3~6倍以上 実施例のアクティブマトリックス基板の動作は、

尚、実施例において、表示手段に液晶を用いた。 4、 図面の簡単な説明、 例で説明したが、本発明における表示手段は何も 第1,図は本発明の一実施例におけるアクティブ 示手段にも使用でき、(又、P.L Z T を用いた光シー。 実施例におけるアクティブマトリックス基板の駆 ャッタにも使用することができる。更に、液晶の 代りに設けた光導電膜のソース配線に印加する電 圧を一定として、ソース配線を洗れる電流の変化 トリックス基板の回路回、第4回は従来のアクテ

を検出するようにすれば、摄像素子にも応用する

になるので、大幅な歩留りの向上と、製造原価の

液晶に限定されるものではなく、ELを用いた表し、マトリックス基板の回路回、第2回は本発明の一 動方法を説明するためのタイミングチャート、第 3 図は本発明の他の実施例におけるアクティブマ

ィブマトリックス基板の回路図である。

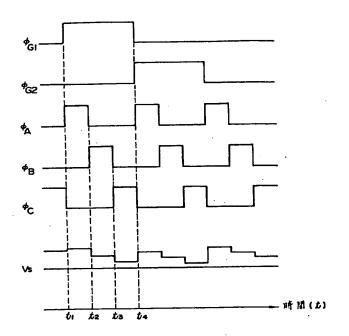
- 6,11 … 第1の薄膜トランジスタ。
- … ゲート記線、 8, … ソース配線、
- … 映像表示手段(被晶表示体)、10 … 映
- 像表示領域、、12 映像信号入力配線、

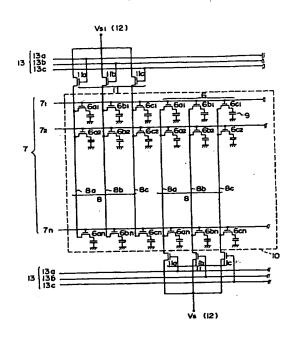
信号切換用ゲート配線・一。

松下電器産業株式会社

运动 医直旋性小原体 1.4

10-- 成化点水形域 11…達陵トランジスタ





第 4 🛛

